PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01236867 A

(43) Date of publication of application: 21.09.89

(21) Application number: 63064133 (71) Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD
(22) Date of filing: 17.03.88 (72) Inventor: HAMASHIMA MITSUHIRO UCHIYAMA TAKASHI

(54) METHOD AND APPARATUS FOR CONVERTING PICTURE ELEMENT DENSITY

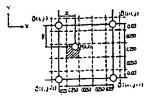
(57) Abstract:

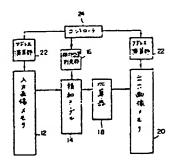
PURPOSE: To obtain a picture element density converting picture with high picture quality in a short processing time by obtaining a data (gradation value) of a data of a picture element to be converted depending to which partial area decided in the relation with some picture elements around the said picture element the data belongs.

CONSTITUTION: After an address of a picture element P(k, l) converted by a controller 24 is decided, a relative position discrimination section 16 applies area decision as to which partial area the picture element P(k, l) to be converted is included. This is implemented, for example, by forming a table corresponding the partial area and the address of the memory to each other in advance and using the table so as to decide to which partial area the picture element to be decided belongs. Then an output (product sum) assigned to each partial area is read from a product sum table 14 and the data (gradation value) of the picture element P(k, l) to be converted is calculated by using the output (product sum). Thus, the gradation obtained

in such a way is stored in an output picture memory 20. Then the processing time is reduced.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio





⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 平1-236867

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)9月21日

H 04 N 1/387

101

8839-5C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

会発明の名称

画素密度変換方法及び装置

②特 頭 昭63-64133

②出 類 昭63(1988)3月17日

⑩発明者 浜島

光 宏

東京都練馬区光が丘7-7-11-1101

@発 明 者 . 内 山

隆 東京都世田谷区経堂3-11-12

创出 頤 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

四代 理 人 弁理士 高 矢 諭 外 2名

明細を

1、発明の名称

画業密度変換方法及び装置

2. 特許請求の範囲

(1) 第1の面景密度で形成された面像データを、 第2の面景密度データに交換する面景密度交換方 法において、

変換すべき画素を含み、原画像の数画素によっ て囲まれた領域を複数個の部分領域に分割して、

各部分領域毎に固有の変換係数と原画業のデー ラとの積を求めて記憶しておき、

変換すべき面景の所貫部分領域を制定して、

該所属部分領域の前記記憶館の加算により、交換すべき画業のデータを求めることを特徴とする 函素密度交換方法。

(2) 第1の画業密度で形成された画像データを、 第2の画素密度データに交換する画素密度変換装 彼において、

変換すべき画素を含み、原画像の数画業によつ て囲まれた領域を複数個に分割した部分領域毎に 固有の変換係数と原画素のデータとの程が、各部 分質域毎に格納された積和テーブルと、

変換すべき画業の所以部分領域を判定する相対 位置判定部と、

該所異部分領域の記憶値を育記積和テーブルから読み出して、変換すべき画業のデータを演算する加集器と、

を含むことを特徴とする百衆密度変換装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、画素密度変換方法及び装置に係り、 特に、第1の画業密度で形成された画像データを、 第2の画素密度データに変換する画業密度変換方 法及び装置の改良に関するものである。

【従来の技術】

例えばレイアウトスキヤナ等を用いて適当な解係度で補助記憶装置等に入力された画像を、プリンタのような画楽密度の異なるハードコピー装置等により所望の大きさで出力する際には、画楽密度を変換して一致させる必要がある。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、ニアレスト・ネイバ法には、気 本化された原西像のうち、特定の函案が完全に欠 落したり重複することから、面像のエツジ部の再 現性が思い等の変換後の面質の劣化が甚しいとい う問題点があつた。

一方、パイ・リニア法やキュービック・コンポリューション法では、首記のようなニアレスト・ ネイバ法での問題点は生じ難く、比較的高品質な 画像が得られるものの、非常に長い処理時間を要するという問題点を有していた。特に、原画像あ

た領域を複数値に分割した部分領域毎に固有の変換係数と原面素のデータとの積が、各部分領域毎に格納された積和テーブルと、変換すべき画素の所属部分領域を判定する相対位置判定部と、該所属部分領域の記憶値を背記積和テーブルから読み出して、変換すべき画素のデータを演算する加算とを含むことにより、同じく背記目的を達成したものである。

【作用】

本発明は、前記従来のバイ・リニア法やキュー ピック・コンポリユーション法で処理時間がかか るのは、非常に計算が複雑なためであることに着 目してなされたものである。

即ち、本発明では、突換すべき画景を含み、原面像の数画景によつて囲まれた領域を複数個の部分領域に分割して、各部分領域毎に固有の交換係数と原面素のデータとの積を求めて記憶して、設所変換すべき画素の所属部分領域を判定して、設所、 このでは、変換すべき画素の所属部分領域を判定して、設所 では、変換すべき画素の所属部分領域を判定して、設定を では、変換すべき画素の所属部分領域を利定して、 では、変換すべき画素の所属部分領域の対記記憶値の加算により、 では、変換すべき画素のデータを求めることにより、 の変換する。 るいは変換画像のデータ量が多い場合、この傾向 が顕著である。

【発明の目的】

本発明は、前記従来の問題点を解消するべくな されたもので、短い処理時間で画質劣化の少ない 画景密度変換を行うことが可能な画景密度変換方 法及び装置を提供することを目的とする。

【課題を達成するための手段】

又、同様の西素密度変換装置において、変換すべき面素を合み、原画像の数画景によつて囲まれ

化して高速化できるようにしている。従つて、短い処理時間で、バイ・リニア法やキュービック・コンポリューション法のような、 画質劣化の少ない高品質の画業密度変換を行うことができる。又、ハードウエア化することも容易である。

(実施例)

以下、包面を参照して、バイ・リニア法で画業 密度変換する場合を例にとつて、本発明の実施例 を辞版に説明する。

第1図は、本実施例の原理を説明するもので、 変換すべき画素を、その階調復等のデータを含め てP(k、 4)とし、この変換すべき画素 P(k、 4)を囲む原画素として、4 囲の原画素 O(i、 」)、O(i+1、j)、O(i、j+1)、O (i+1、j+1)を考える。ここでは、これら 4 個の原面素の間を二次元方向(X 方向及びY方向)にそれぞれ4 分割して、針16 個の部分領域 を形成する場合を示している。

各部分領域は、4個の原画業が、それぞれ部分 領域の中心部にくるように形成されている。即ち、

各部分領域の分割譲は、第1図に破線で示した如く、水平(X)方向、差度(Y)方向の各2個の原画素 O(i、j)、O(i+1、」):O(i、j)、O(l、j+1)の間に、それぞれ4本の分割線が配置されるようになつている。 従って、各原画素 O(i、j)、O(i+1、j);O(i、j)、O(i、j+1)間の距離を1.00とすると、分割線相互の距離は0.25であり、原画素と該原面素に最も近い分割線との距離は、0.125となつている。

今、交換すべき 画衆 P (k 、 2) は、基準 画衆 O (i 、 j) からみて、 + X 方向に第2領域目、 - Y 方向に第3領域目の位置にある。

第2回は、上記名部分領域に付したアドレスを 示したもので、原画素 \overline{O} (i、J)のアドレスを A(\overline{O} 、 \overline{O})とすると、変換すべき画素 \overline{P} (k、 \underline{I})のアドレスは \underline{A} (\underline{I} 、 \underline{O})となる。

本発明においては、まず、各部分領域(アドレスA(0、0)、・・・A(3、3))毎に、第1 表に示す如く、各部分領域のアドレスと原画業

バイ・リニア法の場合、画素密度交換式は、第 1 図において、次に示す如くとなる。

$$P(k, k) = (1-y) \{ (1-x) \\ \times \overline{O}(i, j) + x \cdot \overline{O}(i+1, j) \} \\ + y \{ (1-x) \cdot \overline{O}(i, j+1) \}$$

 + x・O (i+1 、 j+1) } …… (1)

 ここでx は、原面素O (i 、j) と変換すべき

 面素P (k 、 g) との距離の水平方向成分、y は、

 同じく無直方向成分である。

この式を整理すると、次式に示す如くとなる。 $P(k, 2) = a \cdot O(i, j)$

+
$$b \cdot \overline{0}$$
 ($i+1$, j)
+ $c \cdot \overline{0}$ (i , $j+1$)
+ $d \cdot \overline{0}$ ($i+1$, $j+1$)

........ (2)

この(2)式において、係数a、b、c、dの値は、各々16通りであり、原画業〇(i、j)、〇(i、j+1)、〇(i+1、j)、〇(i+1)、〇(i+1)、〇(i+1)の階調を8ビツトで表現するものとすると、各々256通りとなり、この(2)式の

のデータ(階調値)から決定される、交換係数と 階調値の積を予め計算して、出力値Vとして記憶 しておく。第1表は、原面素 O(i、」)に関す る積和テーブルの例を示したものである。

第 1 表

部	分	釵	坂	n		戚	画	*	n	出	カ	练	v	(奕	换	Ø	改	х		7
Z	ĸ	٧	<u> ح</u>			融	6	但		L				原	西	*	ŋ	隙	Ħ	值	뇐
A	(0		0)		0								0						
A	(0		0)		1							1	6						
<i>₩</i>		:			7	_	:		7	7				:							$\hat{\tilde{\gamma}}$
A	(0		0)	2	5	5				4	0	8	0						
A	(0		1)		0								٥						
A	(0		1)		1							1	2						ĺ
1		:			4	۲	:		7	ř				:							+
A	(0		1)	2	5	5				3	0	6	0						1
7		:			1	١	:		7					:							-
A	(1		2	>	1	0	0					6	0	0						
*		:			7		:		7	۲				:							*
عا	۷	3	_	3	ر	2	5	5							0						

各項は有限個の要素から成り立つ、従つて、この 値を各項毎にテーブル化して、積和テーブルとす ればよい。

この 枚和テーブルは、各原面素 〇(i、j)、〇(i+1、j)、〇(i、j+1)、〇(i+1、j+1)、〇(i+1、j+1)用にそれぞれ用意しておく。ここで、原画素 〇(i、j)用の積和テーブルの出力値を V x 、原画素 〇(i、j+1)用の積和テーブルの出力値を V x 、原画素 〇(i、j+1)用の積和テーブルの出力値を V x とする。

この積和テーブルを用いた、変換すべき面素の 階調値の計算は、第3図のようにして行う。

即ち、まずステップS1で、変換すべき 医素 P (k 、 2)がどの部分領域に含まれるかを判定す

次いでステップS2に進み、前出第1表に示したような積和テーブルから、所属部分領域のアドレスA(II、II)と原画素の階調値から決定される出力値V1~V4を各原画業年に読み出す。

á

次いでステツアS3に進み、次式の計算によつ て、交換すべき西索の階詞値P(k 、 4)を算出 する。

P (k . 1)

7

=K(V₁(Ō(i,j),A(B,n)) +V₂(Ō(i+1,j),A(B,n)) +V₃(Ō(i,j+1),A(B,n)) +V₄(Ō(i+1,j+1),A(B,n))

このようにして変換後の各面素の階調値が求め られ、求められた階調値は例えば出力画像メモリ に記憶される。

なお、前記説明においては、菌素密度変換に用いる補間法としてバイ・リニア法が用いられていたが、キューピック・コンポリユーション法等、他の補間法を用いてもよい。

育記実施例により両素密度変換を行うための面 業密度変換装置 1 0 の実施例の構成を第 4 図に示す。

本実施例は、例えばレイアウトスキヤナ等を用

コントローラ24で変換すべき面乗 P(k、 2)のアドレスが判定された後、ステツア S 1 に進み、相対位置判定部 1 6 で、変換すべき顕素 P(k、 2)が、どの部分領域に含まれるかの領域判定を行う。これは、例えばメモリのアドレスと部分領域とを対応付けたテーブルを予め作成しておき、判定すべき面集がいずれの部分領域に属するかをチーブルによって刊定することによって行う。

次いでステツアS2に進み、前出第1表のような費和テーブル14から、各部分領域に割当てられた出力値(積和値)V:~V。を読み出す。

次いでステップS3に強み、読み出した出力値 (積和値)を使つて、前出(3)式により変換すべき画素P(k、4)のデータ(階調値)を算出する。

このようにして各変換画素の階調値が求められ、 求められた階調値が前記出力画像メモリ20に記 性される。

第5回は、本発明に係る西景密度交換設置 1 0 が採用された応用例の装置構成を示したものであ 育記積和テーブル 1.4 には、前出第 1.3 に示したような表が、各項首素O(i,j)、O(i+1,j)、O(i+1,j+1)、O(i+1,j+1)

以下、前出第3回を再び参照して、実施例の作用を説明する。

ъ.

本実施例においては、種和テーブル14を記憶するに限して、変換すべき画素P(k、l)を含み、4個の版画素によつて囲まれた領域を4×4で16個の部分領域に分割していたので、積和テーブル14から該当する積和値を迅速に読み出す

ことができ、ハードウエア化も容易である。なお、 変換すべき面景を含む原画業の数や、部分領域の 数は、これに限定されない。

又、背記実施例においては、パイ・リニア法に より面素密度変換式を導出し、これから複和値を「 求めていたが、積和値を求める方法はこれに限定 されず、キュービック・コンポリユーション法等、 他の方法による画素密度変換式を用いることも可 能である。

【発明の効果】

以上説明した通り、本発明によれば、変換すべ き画素のデータ(階調値)を、この変換すべき画 素を取団む、いくつかの菌素との関係で定めた部 分類域のいずれに思するか、及び、原面像のいく つかの菌素のデータ(階調値)によつて求めるよ うにしたので、変換すべき面景が決まれば、後は 加算とピツトシフトを練返すのみで、データ(階 胡雄)を的確に算出することができる。従つて、 比較的短い処理時間で、パイ・リニア法やキユー ビツク・コンポリユーション法等のような高層質

の面景密度変換画像が得られる。又、ハードウエ ア化も容易である等の優れた効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明に係る画業密度変換方法の実 施例の原理を説明するための、変換すべき画景と 原西素の相対的な位置関係を示す線図、第2図は、 第1図に示した部分領域のアドレスを示す鉄図、 第3回は、前記実施例の処理手順を示す流れ図、 第4回は、本発明が採用された画素密度変換装置 の実施例の構成を示すプロツク級図、第5図は、 前記実施例が採用された応用例の装置構成を示す プロツク線図、第6図は、本発明による処理を行 う前と後のデータの例を比較して示す線図である。

P (k 、 l) … 交換すべき画素、 〇(1、1)…原画業、

A (m 、n) ーアドレス'、

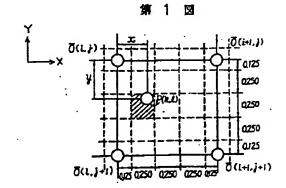
Vi~V。…出力值、

10… 画景密度变换数置、

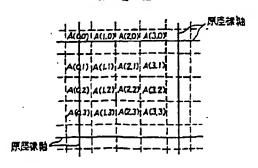
12…入力関係メモリ、

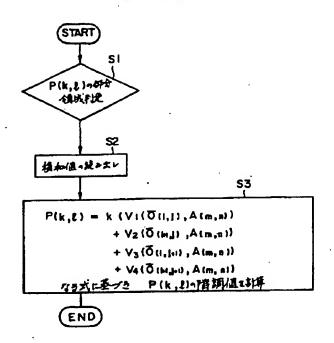
- 14…積和テーブル、
- 16…相対位置判定部、
- 18…加算器、
- 20…出力面像メモリ。

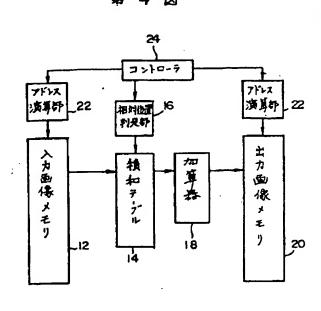
代理人

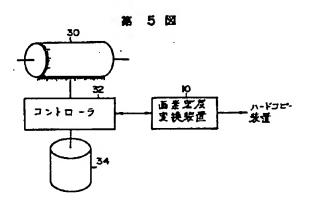


第 2 図









務 6 図

